



大塚 照久, Teruhisa Ohtsuka

XPS等分析と熱処理装置を担当しています。

計測機器類を中心に、大抵の機器は操作と共に簡単な修理もできます。

半導体の試作量産工場で計測計測器機を担当し、様々な物理量を計測する機器を取り扱ってきました。また、試作開発から量産向け自動計測、試験機器の設計にも携わり、制御ソフトやファームウェア開発も経験しています。

鉄シリサイド太陽電池の研究開発に携わった事もあり、計測器機を手作りしながら光電変換特性等を測定した^[1-3]。また、酸化物半導体トランジスタやEUV励起光電子分光法(EUPS)^[4]の研究にも従事し、これらの経験も動員して研究支援に従事しています。NPFでは、XPSやMPMS等の計測器機と、RTA等の熱処理機器と共に、イオン注入装置を担当しています。装置の内部構造や仕組みが分かるオペレータとして、装置を壊さない範囲で最大限の性能を引き出すことを生業としています。

経歴: ナノテク支援の経験年数 約6年

民間企業 (半導体製造技術開発、装置開発、太陽電池研究開発) 約10年

その他 (司法書士補助者) 約4年

¹ Appl. Phys. Lett. 91, 142114 (2007), ² Appl. Phys. Lett. 92, 042117 (2008), ³ Appl. Phys. Lett. 92, 192114 (2008)

⁴ https://unit.aist.go.jp/dsu/ci/tf/vol4/tf_vol4_poster_Part5.pdf, <https://staff.aist.go.jp/t-tomie/EUPS/>

